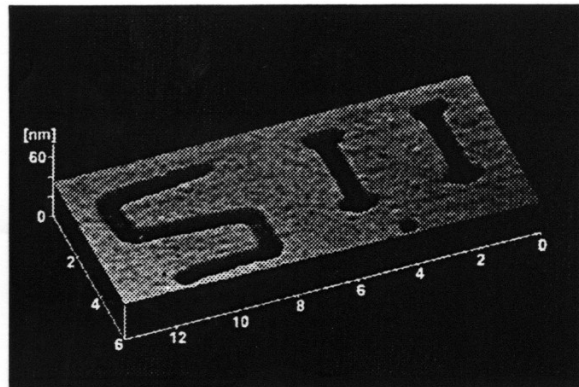
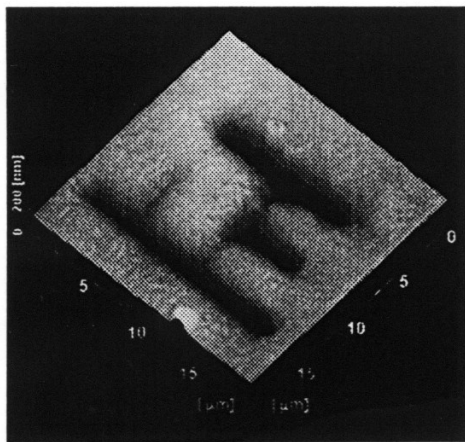


マイクロ電解加工技術とマイクロ光加工技術



マイクロ電解加工により形成したパターン

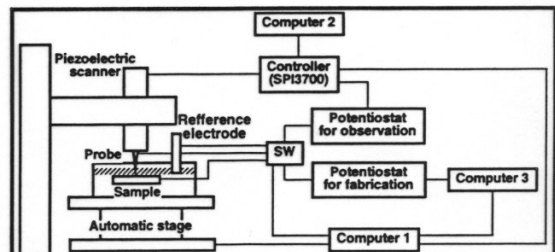
マイクロ光加工により形成したパターン

■研究概要

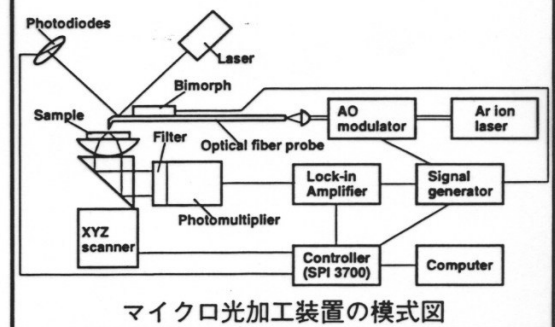
走査型プローブ顕微鏡(SPM)の機構を利用して、極小領域における電気化学的加工及び光加工を行うことに成功しました。

■特徴・性能

	マイクロ電解加工	マイクロ光加工
加工分解能	0.2 ~ 0.3 μm	0.2 ~ 0.3 μm
加工領域	150 x 150 μm	150 x 150 μm
加工速度	100 nm/sec	0.1 ~ 10 $\mu\text{m}/\text{sec}$
特徴	除去と付加の両方の加工が可能	光の波長よりも高い分解能



マイクロ電解加工装置の模式図



マイクロ光加工装置の模式図

セイコー電子工業(株)

本研究は、工技院産技プロジェクトの一環として NEDO から委託を受けた(財)マイクロマシンセンターの再委託業務として、セイコー電子工業(株)が実施したものである。